## Магнетосопротивление в массиве квантовых точек с разной степенью локализации носителей заряда

N.P. Stepina, E.S. Koptev, A.G. Pogosov, A.V. Dvurechenskii, A.I. Nikiforov





INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS, SIBERIAN BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE

# Содержание

## <sup>°</sup> Мотивация

- Образцы с разной степенью локализации
- Температурная зависимость проводимости
- Экспериментальные результаты по МС

Отрицательное MC: VRH модель

Отрицательное МС: WL модель

• Заключение



# Ge нанокластеры в Si

#### Поперечный срез ПЭМ

СТМ изображение Ge нанокластеров



10 MC Ge 300°C

Зонная структура





40 нм

Плотность 3-4×10<sup>11</sup>см<sup>-2</sup>

#### Латеральный размер 10 -15нм

Высота 1-1.5 нм

Большая плотность КТ позволяет наблюдать прыжковую проводимость вдоль 2D массива КТ



### Прыжковая проводимость дырок

NЛ



#### Анализ безразмерной энергии активации

$$G(T) = \gamma T^{m} \exp\left[-\left(T_{0} / T\right)^{x}\right]$$

$$w(T) = d \ln G / \ln T \quad w(T) = m + x (T_0 / T)^x$$
$$m \ll x (T_0 / T)^x$$
$$\ln w(t) = A - x \ln T$$



Немонотонная зависимость проводимости от заполнения- характерная особенность КТ.







Потенциал, созданный массивом КТ

## Режимы транспорта



### Пути изменения проводимости



Плотность КТ~4×10<sup>11</sup> см<sup>2</sup> Фактор заполнения v~2, 2.4 Отжиг 480, 550, 575, 600 и 625°С



НТREМ изображение КТ с плотностью ~4·10<sup>11</sup> см <sup>-2</sup>

Плотность КТ 8×10<sup>11</sup> см<sup>-2</sup>

Фактор заполнения v ~3



СТМ изображения массива Кт с плотностью ~  $8 \times 10^{11}$  см  $^{-2}$  (200×200 нм)



### Пути изменения проводимости

3. Изменение размеров Кт и состава при отжиге



КТ плотность~4×10<sup>11</sup> см<sup>-2</sup> Фактор заполнения v~2, 2.4 Отжиг 480, 550, 575, 600 и 625°С



## Мотивация

### Переход от прыжкового к диффузионному транспорту

#### Температурная зависимость проводимости

#### Нелинейная проводимость



### Отрицательное магнетосопротивление

#### ОМС в режиме слабой локализации

ОМС в VRH режиме



В магнитном поле 
$$\delta \sigma = -G_0 ln \frac{\tau \varphi}{\tau}, \quad \frac{\tau \varphi}{\tau} \gg 1$$
  
 $\frac{\Delta \sigma^{WL}(b)}{G_0} = \alpha \left\{ \psi \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{b} \frac{\tau}{\tau_{\varphi}} \right) - \ln \left( \frac{1}{b} \frac{\tau}{\tau_{\varphi}} \right) \right\} = \alpha Y(b, \tau/\tau_{\varphi})$   
 $b = B/B_{tr}, B_{tr} = h/2el^2, \psi$ - digamma функция

$$ln\frac{\sigma(H)}{\sigma(0)} = \langle ln\frac{\sigma_{ij}(H)}{\sigma_{ij}(0)} \rangle$$
$$ln\frac{\sigma(H)}{\sigma(0)} \sim N\mu\xi(|\mu|\xi)^{\frac{1}{2}}rB$$

μ - амплитуда рассеяния<0, r- длина прыжка



### Температурная зависимость проводимости

МЛ



	1	2	3	4	5	6	7
$\xi$ , nm	2250	390	360	91	62	47	20

### Магнетосопротивление



## Negative magnetoresistance, VRH model



## Отрицательное MC, WL модель

$$\delta G(B) = \alpha \frac{e^2}{2\mathbb{X}\pi^2} \left[ \psi(\frac{1}{2} + \frac{\mathbb{X}}{2BeL_{\varphi}^2}) - \psi(\frac{1}{2} + \frac{\mathbb{X}}{2Bel^2}) + 2\ln(\frac{L_{\varphi}}{l}) \right]$$



$$\sigma = \sigma_{dr} - 2G_0 ln \frac{L_{\varphi}}{l}, \frac{L_{\varphi}}{l} \gg 1$$

$$\sigma_{dr} = \frac{e^2 n\tau}{m} = \pi k_F l G_0$$

## Отрицательное MC, WL модель

ξ	L <sup>*</sup>	I	ξ*	k <sub>F</sub> I	α	$\sigma_{\sf dr}$	σ,4Κ	
47	134	14.3	135	1.43	6e-6	5.5e-5	5.8e-9	6
62	142	14.5	141	1.45	1e-5	5.6e-5	2.8e-8	5
91	86	12.3	85	1.23	3e-5	4.8e-5	5e-8	3
390*	50.5	10.8	59	1.08	0.0045	4.2e-5	4e-6	2
2250*	12.1	4.7	24	1.04	0.79	4.06e-5	1.7e-5	1

$$\frac{1}{L_{\varphi}^{*2}} = \frac{1}{L_{\varphi}^{2}} + \frac{1}{\xi^{*2}}$$
$$\xi^{*} = l \exp(\pi k_{F} l/2)$$
$$L_{\varphi} \gg \xi^{*}, L_{\varphi}^{*} = \xi^{*}$$



## Температурная зависимость МС





## Заключение

Предложены пути получения структур с массивом КТ с широким диапазоном изменения проводимости.

Анализ температурных зависимостей проводимости подтверждает переход от прыжкового к диффузионному транспорту при изменении проводимости системы.

Анализ поведения магнетосопротивления в промежуточной области значений G (  $k_F l \le 1$  ) выполнен для структур с различными размерами и составом КТ, при изменении их плотности и заполнения КТ дырками.

#### Выводы:

- 1) Режим МС подобен для всех исследованных структур. В слабых полях наблюдается отрицательное МС, которое переходит в положительное при увеличении поля.
- 2) Анализ отрицательного Мс выполнен в приближении прыжковой проводимости и слабой локализации.
- Показано, что приближение слабой локализации описывает поведение отрицательного МС для всех образцов, однако параметр α стремиться к нулю при уменьшении проводимости.
- Результаты объяснены в предположении, что вклад квантовой интерференции ограничен не только длиной сбоя фазы, но также длиной локализации.

# Эффективная масса

$$L_{\phi}^{*} = \sqrt{D\tau_{\phi}} \qquad D = l^{2} / \tau = v_{F} l = \mathbb{Z} k_{F} l / m$$

модель самосогласованной интерференционной поправки к проводимости [B.L. Altshuler, A.G. Aronov, and D.E. Khmelnitsky, J. Phys. C 15, 7367 (1982)]

$$\frac{1}{\tau_{\varphi}} = \frac{k_{B}T}{\boxtimes g} \ln \frac{k_{B}T\tau_{\varphi}}{\boxtimes} \qquad \qquad D = \frac{(L_{\varphi}^{*})^{2}}{\tau_{\varphi}} \longrightarrow m = \frac{\boxtimes k_{F}l}{D}$$

 $4 \times 10^{11} \ cm^{-2}$  $m = 0.1m_e$  $8 \times 10^{11} \ cm^{-2}$  $m = 2m_e$ 



### Структуры для исследования





